

核融合科学研究所プラットフォーム企画室運営規則（案）

制 定 令和 年 月 日 規則 号

（目的）

第1条 この規則は、核融合科学研究所組織運営規則（令和5年 月 日規則第 号。以下「規則」という。）第9条第4項の規定に基づき、プラットフォーム企画室（以下「企画室」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

（企画室会議）

第2条 企画室に企画室会議を置く。

2 企画室会議は、核融合科学研究所（以下「研究所」という。）が有する研究施設の管理、運用及び共同利用の企画に関する事項について審議する。

3 企画室会議は、次に掲げる者をもって組織する。

（1） 企画室長

（2） 次条に定める各部門の長

（3） その他企画室長が必要と認めた者

4 企画室長は、企画室会議を招集し、その議長となる。

5 前各項のほか、企画室会議の開催及び審議方法に関し必要な事項については、別に定める。

（部門）

第3条 企画室に、次に掲げる部門を置く。

（1） 大型ヘリカル装置（以下「LHD」という。）部門

（2） 計算機部門

（3） 工学系施設部門

2 企画室の室員は、前項に定める部門のいずれか又は複数の部門に属するものとする。

3 LHD部門は、別表第1に掲げるLHD等の管理及び運用を担当する。

4 計算機部門は、別表第2に掲げるスーパーコンピュータ等の管理及び運用を担当する。

5 工学系施設部門は、別表第3に掲げる実験施設の管理及び運用を担当する。

（部門長）

第4条 各部門に部門長を置き、所長が指名する教授又は准教授をもって充てる。

2 部門長は、該当する部門の運営を掌理する。

（任期）

第5条 第2条第3項第3号に定める企画室会議の構成員、第4条第1項に定める部門長及び規則第9条第2項に定める企画室の構成員（以下「構成員等」という。）の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の構成員等に欠員が生じたときは、その都度補充する。この場合における構成員等の任期は、前任者の残任期間とする。

（庶務）

第6条 企画室の庶務は、管理部研究支援課及び施設・安全管理課において処理する。

（雑則）

第7条 この規則に定めるもののほか、企画室及び第3条第1項各号に定める部門の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第 1（第 3 第 3 項関係）

No	カテゴリー	設備（プラットフォーム）名	設置場所
1	磁場閉じ込め装置	LHD	ヘリカル実験棟

別表第 2（第 3 第 4 項関係）

No	カテゴリー	設備（プラットフォーム）名	設置場所
1	数値実験・ データベース・ データ解析装置	プラズマシミュレータ	シミュレーション科学研究棟
2		パーティキュラリティ装置 (CompleXscope)	シミュレーション科学研究棟
3		原子分子数値データベース	シミュレーション科学研究棟
4		実験データ収集・解析システム	制御棟
5		SNET	

別表第 3（第 3 第 5 項関係）

No	カテゴリー	設備（プラットフォーム）名	設置場所
1	低温実験設備	超伝導マグネット研究設備	超伝導マグネット研究棟
2	炉内材料機器研究設備	熱・物質流動ループ装置 Oroshi-2	総合工学実験棟
3		高温静水圧焼結接合システム	加熱圧縮機室棟
4		クリープ試験機	総合工学実験棟
5		遊星型ボール・ミリング装置	総合工学実験棟
6		超薄膜ナノスクラッチ試験機	総合工学実験棟
7		高純度アーク溶解装置	総合工学実験棟
8		不活性雰囲気大容量遊星型ボール	総合工学実験棟
9		高速衝撃試験装置	加熱圧縮機室棟
10		表面改質試験装置（SUT）	開発実験棟
11	材料分析装置	超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡 (FE-SEM)	総合工学実験棟
12		走査型電子顕微鏡(SEM)	総合工学実験棟
13		X線光電子分光分析装置（XPS(ESCA)）	総合工学実験棟
14		X線回折装置（XRD）	総合工学実験棟
15		タンデム加速器	総合工学実験棟
16		超高熱負荷試験装置（ACT2）	加熱圧縮機室棟
17	材料分析装置 (放射線管理区域内)	透過型電子顕微鏡（TEM/STEM）・ ジェントルミル	大型ヘリカル実験棟地下
18		集束イオンビーム/電子ビーム加工観察 装置（FIB-SEM）	大型ヘリカル実験棟地下
19		走査型電子顕微鏡	大型ヘリカル実験棟地下
20		グロー放電発光分析装置（GE-ODS）	大型ヘリカル実験棟地下

21	イオン源・ ビーム研究装置	中性粒子入射加熱法開発試験装置 (NBI テストスタンド)	総合工学実験棟
22		大強度イオン源	開発実験棟
23		多価イオン源 (CoBIT)	開発実験棟
24	プラズマ基礎・ 材料照射実験装置	大口径高密度プラズマ発生装置 (HYPER-I)	開発実験棟
25		直線型プラズマ装置 TPD-II	開発実験棟
26		ペン型大気圧プラズマジェット装置	開発実験棟
27		ワイドストライプ型高密度室温大気圧 プラズマ装置	開発実験棟